FORMATION OF SOLAR ARRAY

Publication number: JP6013633 Publication date: 1994-01-21

Inventor: JYURES

JIYURESU DEII REBIN; MIRAADO JIEI JIENSEN;

RONARUDO II HENEI

Applicant: TEXAS INSTRUMENTS INC

Classification:

- international: H01L31/04; H01L31/042; H01L31/18; H01L31/04;

H01L31/042; H01L31/18; (IPC1-7): H01L31/04

- European:

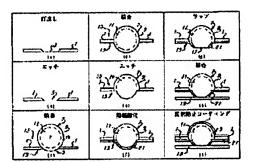
Application number: JP19930062068 19930322 Priority number(s): US19840647942 19840904 Also published as:

| JP61124179 (A)

Report a data error here

Abstract of JP6013633

PURPOSE: To economically manufacture a solar array. CONSTITUTION: A semiconductor grain 7, having a 1st conductive epidermal part 9 and a 2nd conductive inner part 11, is arranged on an aperture 5 of an aluminum foil 1, so as to be projected from both the sides of a foil 1, and the epidermal part 9 on one side is removed to form an insulating layer 21. Then a part of the inner part 11 and the insulating layer 21 formed on the part are removed, and a 2nd aluminum foil 19 is connected to the removed region 17. The planar region 17 provides a fine ohmic contact with the 2nd aluminum foil 19 as a conductive part.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-13633

(43)公開日 平成6年(1994)1月21日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ 庁内整理番号

技術表示箇所

H01L 31/04

7376-4M

H01L 31/04

Α

審査請求 有 発明の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-62068

(62) 分割の表示

特願昭60-195698の分割

(22)出願日

昭和60年(1985)9月4日

(31)優先権主張番号 647942

(32)優先日

1984年9月4日

(33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 590000879

テキサス インスツルメンツ インコーポ

レイテツド

アメリカ合衆国テキサス州ダラス、ノース

セントラルエクスプレスウエイ 13500

(72)発明者 ジユレス デイー. レビン

アメリカ合衆国テキサス州ダラス、フリン

トコウブ ドライブ 6931

(72)発明者 ミラード ジエイ. ジエンセン

アメリカ合衆国テキサス州バルチ スプリ

ングス, オウク トリー 11428

(74)代理人 弁理士 浅村 皓 (外2名)

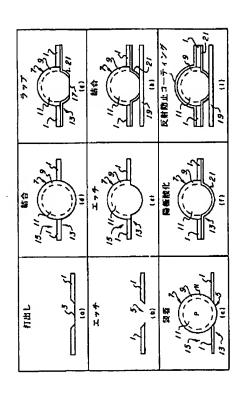
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ソーラー・アレーの形成方法

(57)【要約】

【目的】 ソーラー・アレーを経済的に製造する。

【構成】 第1導電形表皮部9と第2導電形内部11を 有する半導体粒子7をアルミ箔1の開口5にアルミ箔1 の両側から突出するように配置し、片側の表皮部9を除 去し、絶縁層21を形成する。次に第2導電形内部11 の一部及びその上の絶縁層21を除去し、その除去され た領域17に第2アルミ箔19を結合する。その平坦な 領域17が導電部としての第2アルミ箔19に対し良好 なオーミックコンタクトを提供する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ソーラー・アレーを形成する方法に於いて、

- (a) 第1のアルミ箔を用意し、
- (b) 前記第1アルミ箔の所定位置に開口を形成し、
- (c) 表皮部が第1導電形でその表皮部下が第2導電形の半導体粒子を前記開口の各々に、該半導体粒子が前記第1アルミ箱の両側から突出するように配置し、
- (d) 前記第1アルミ箱の片側にある前記第1導電形表皮部を除去し、
- (e) 前記第1アルミ箔の前記片側、並びに前記第1 導電形表皮部が除去された前記半導体粒子面の上に絶縁 層を形成し、
- (f) 前記第1導電形表皮部が除去された前記半導体 粒子面の一部、並びにそれを覆う前記絶縁層を除去し、
- (g) 前記半導体粒子面の一部が除去された領域に第2のアルミニウム箱を結合するステップを含むソーラー・アレーを形成する方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は金属箔マトリクス内に 配置されたシリコンの球から、露光した時に発電する太 陽電池(ソーラー・セル)を形成する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】太陽光線を他の形の有用なエネルギに変 換することによつてエネルギを発生する装置はよく知ら れており、太陽が主なエネルギ源であるという経済性の 為、こういう装置は絶えず開発され且つ改良されてい る。この様な1つの装置が米国特許第4,021,32 3号に記載されており、この米国特許では、硝子又はプ 30 ラスチックの様な透明なマトリクスで構成されたソーラ ー・アレーに、その片側にN形表皮部を持つP形のシリ コン、又はその片側にP形表皮部を持つN形シリコンの 粒子をマトリクス内に埋込んで設けたソーラー・アレー が記載されている。大体半分の粒子がN形表皮部を持つ P形であり、残りがP形表皮部を持つN形であることが 好ましいが、この構成を変えることが出来る。マトリク スの裏側では、それから突出する粒子が適当な導電メタ ライズ部分によって相互接続される。シリコン粒子の表 皮部がマトリクスの前側から伸出す。こういうアレー 40 は、マトリクスの前側と接触する電解質、好ましくは臭 化水素酸(HBr)内に浸渍する。電解質と接触する異 なる導電型のシリコン粒子の間の電位差の為、HBrを 泡立つ水素ガスと溶解したままになっている臭素とに電 気分解する太陽光の下で、その間に電位差が設定され る。水索ガスを収集し、例えば燃料電池等の様なエネル 半源とするが、これは周知である。

【0003】こういう形式のソーラー・アレーでは、シ て、空気がこの開口を通過することを遮断する。最初は リコン粒子が電気分解に独立に参加する。その結果、ア 開口の数に較べて過剰の数の球を使うので、最終的には レーによって反応生成物が発生される速度は、若干の粒 50 全ての開口が球で埋められ、その後使われなかった球

子のP-N接合が短絡し又は分路されても、あまり影響を受けない。

【0004】太陽光線から有用なエネルギを発生する別の装置は、上に述べた種類と同様であるが、電気分解を行なわずに、電力を発生する様に構成されている。この様な1つの装置が米国特許第2,904,613号に記載されている。その他の構成も可能であるが、役に立つ実施例は、硝子又はプラスチックの様な透明マトリクスにP形表皮部を持つN形シリコンの粒子を設けて構成される。粒子のN形のコアがマトリクスの裏側から突出し、適当な導電メタライズ部分によって相互接続される。P形表皮部がマトリクスの前側から突出し、細い金属格子の上の酸化錫の様な導電性で透光性の材料によって相互接続される。太陽光の下では、このアレーの後側及び前側の相互接続部の間に電位差が設定され、それを適当に接続して、外部の電気負荷に直接的に給電することが出来る。

【0005】この技術の改良が米国特許出願第562, 782号に記載されている。この出願には、前に述べた 20 発明の改良が記載されている。

[0006]

(2)

【発明が解決しようとする課題】然し、現状では、上に述べた従来の方法に従って、ソーラー・セルを製造するコストはあまり経済性がなく、この従来の方式はこれまで経済的に大きな成功を収めていない。従って、経済的に成り立ち得るソーラー・セルを供給する為には、こういうアレーを比較的高価ではなく経済的に製造出来ることが絶対条件である。

[0007]

【問題を解決するための手段】この発明では、上に述べた従来の問題を大幅に削減し、前に引用した従来技術と較べて、ソーラー・アレーを経済的に製造することが出来る様なソーラー・アレーを形成する方法を提供する。

【0008】簡単に言うと、この発明では、その表面に 自然の酸化アルミニウムを持つと考えられる様な標準型 の可撓性アルミニウム箔の第1のシートを設けて、ソー ラー・アレーを形成する。シリコンの球を配置すべき場 所で箔を打出して、金属マトリクスを形成する。その 後、箔をきれいにして有機物を除き、打出しを行なった 薄い区域を除去してそこに開口を作る為にエッチングを し、シリコン球を挿入する為の場所を作る。別のエッチ ング工程を用いて、箔にマット面(mattesurf ace)を作る。箔が、それに適用すべき球に対するハ ウジングを形成すると共にその前側接点を形成する。P 形の上にN形表皮部を持つシリコンの球を箔の表側にデ ポジットし、箔の裏側に真空チャックを設けて、球を前 以って形成した開口に吸込み、その中に途中まで入れ て、空気がこの開口を通過することを遮断する。最初は 開口の数に較べて過剰の数の球を使うので、最終的には

.3 は、箔の後面をブラッシング等することによって除去さ れる。

【0009】次にシリコンの球をインパクト・プレスを 使うことによってアルミニウム箔に結合する。このプレ スが球を開口の中に押込み、球の赤道が箔より上方にあ って、箔の表側(太陽又は光の方を向いた側)に来る様 にする。強い力で球を開口の中にこの様に押込むことに より、シリコンの球と接触した表面のアルミニウムが裂 け、その場所で新鮮なアルミニウムが露出する。アルミ ニウムに対するシリコンの球の移動によって生ずる剪断 10 力を持つモジュールを作る。 により、表面の酸化アルミニウムも削り落されて、この 様な露出した新鮮なアルミニウムが得られる。この作用 は、アルミニウム箔、特に露出したアルミニウムと接触 する球の部分から、酸化シリコンの実質上前部を除去す る。この作用は、約500℃乃至577℃未満の範囲内 の温度にアルミニウムをおいて行なわれ、この時、アル ミニウムは固体であるが変形し易くなり、これに対して シリコンはこの温度では依然として剛体である。(イン パクトの持続時間が十分短かければ、577℃より高い 化シリコンを浸食し、インパクトの際、インパクトを加 えた場所で実質的にそれを除去する。この様にして、シ リコンとアルミニウムの間の結合が得られ、シリコンの N形表皮層に対するアルミニウム接点が形成される。こ の後、箔と球から成るアレーを周囲温度まで冷却して、 箔が再び硬化するのに任せる。

【0010】次に、球が露出している箔の裏側をエッチ して、そこにあるN形表皮部を除去する。これは、アル ミニウム箔がシリコン・エッチャントに対するマスクと して作用するからである。箔自体は、普通はその上にご 30 く薄い自然の酸化物コーティングが形成されている為 に、あまり反応性はない。次に、アレーを硫酸パス(b ath) (約10%H2 SO4) 内に約1/2分間入れ てアレーを陽極酸化し、アルミニウムの上に酸化物コー ティングを設ける。次に、アルミニウムを密封してシリ コンを陽極酸化する為に、O. 5%H。PO(を含む別 の陽極酸化パスを用いる。この様にして約10μmのA 12 O3 及び0. 1 μmのS1O2 が成長する。次に球 の後面をラップして、それと接触させる為の面を設け る。ラップ過程により、この面が粗面化され、この為良 40 好なオーミック接点が形成されるようになる。次に、蒋 いアルミニウムの第2の箔をラップした面に適用し、5 00℃乃至577℃未満の範囲内の温度まで予熱した 後、箔をラップした領域にインパクト・プレスして、こ の領域に対する接点を形成する。

【0011】リール形実施例でアレーを形成する場合、 第2の箔を球に結合する前に、隣接するアレーの間の場 所で、表皮部を2つの箔の間に配置する。この実施例で は、第2の箔を球に結合する際、上側及び下側の箔を表 皮部に押付けるが、それと結合はしない。その後、アレ 50

ーの両側で、表皮部の上で箔を適当にけがき、アレーの 両側で、各々の箔に対する箔延長部を設ける。次にこの 箔延長部を直列回路に互いに接続して、拡大回路を形成 することが出来る。

【0012】上に述べた様な表皮部を持つアレーをけが き、互いに分離し、面取りして、長方形のアレーの片側 だけが接点の形で外向きに伸びる第2の箔部分を持つ様 にすることが出来る。こういう接点を他のアレーの第1 の箔部分に任意の幾何学的な形で接続して、入力及び出

【0013】その結果、各々のシリコンの球のおもな部 分がアレーの前側に配置されて太陽光線を受取る為に利 用し得る表面の大きさを大きくしたソーラー・セルが得 られる。更に、当然ながら、このアレーは可撓性であ り、アルミニウム箔に光反射器を持っており、比較的少 数の高価ではない材料及び処理工程を用いて提供され る。

[0014]

【実施例】第1図及び第2図には、この発明に従ってソ 温度にすることも出来る。) 新鮮なアルミニウムが2酸 20 ーラー・アレーを形成する為の、この発明の特徴を利用 した処理工程が略図で示されている。最初、厚さ約2ミ ルのアルミニウム箔1を用意する。この箔は可撓性であ って、環境に対して普通に露出している為に、その表面 にごく薄い自然の酸化物層を持っているのが普通であ る。以下の説明はソーラー・アレーの1個の部材に関す るものであるが、前に説明した従来技術から判る様に、 アレー全体には多数のアレー部材があることを承知され たい。

> 【0015】最初にアルミニウム箔1を(a)に示す様 に周期的な6角形の配置で、例えば中心間16ミルで打 出し、厚さが薄くなった打出し部3は、その中に配置し ようとする球の直径より若干小さい直径にする。打出し 部は円形又は6角形の様なその他の幾何学的な形であっ てよい。多角形の打出しの場合、中心を通って多角形を 横切る線は、これに適用する球の直径より小さくする。 次に、箔を洗浄して有機物を除去し、その後(b)に示 す様に熱した水酸化ナトリウム又はカリウムを用いてエ ッチし、箔の内、打出し部3を作った領域を除去すると 共に、その場所に開口5を設ける。打出し領域3は、エ ッチングの間、箔の他の部分よりも一層薄手である為 に、箱の他の部分より先に除去されると共に、そこで行 われた打出しによる冷間加工がなされている為にも、エ ッチされるのが一層速い。これをアルミニウム・マトリ クスと呼ぶ。

【0016】この点で、随意選択により、25%HF、 60%HNO3 及び15%氷酢酸であるエッチャントの 50%溶液を用いたエッチングにより、箔に或る生地を 持たせ、後方反射を最小限に抑えるマトリクス面を作る ことが出来る。

【0017】(c)に示す様に、N形表皮部9及びP形

内部11を持つ複数個のシリコンの球7を箔1上のマト リクスの上側15にデポジットし、真空チャックを用い て箔の裏側13に真空を加えて、球7を開口5の中に引 込む。最初に箔の裏側では、開口5の数に比べて過剰の 球?を用いるので、全ての開口が球?で埋まり、その後 過剰の球7がプラシがけ等により、 箱1の上側から除去 される。ここで用る球は直径が14.5ミルであること が好ましく、前に述べた様に、開口5の断面直径は1 4. 5ミルより小さく、箱の裏側で箱に真空がかけられ るが、その理由は後で説明する。

【0018】この後、(d)に示す様に、箔を加熱し、 ついでインパクト・プレスを使うことにより、球?がア ルミニウム箔1の開口5の中に結合される。この時、球 7が素早く開口5の中に埋込まれ、開口内で剪断作用を 生じ、それが開口の所の箔の内面にある酸化アルミニウ ムを削取り、新鮮なアルミニウム元素を露出する。前に 述べた様に、球7が開口5の中に埋込まれる時にアルミ ニウムは530℃の温度に加熱されており、この為アル ミニウムは反応性であって、機械的な性質が幾分粘性を 球の上にある非常に薄い自然の酸化シリコン層と反応し て、それを除去し、この為箔1のアルミニウムがこの時 球のN形層 9 内にあるシリコン元素と直接的に結合し て、それに対する接点を形成することが出来る。

【0019】球の赤道がアルミニウム箔1より上方、又 はその上方15にある様に、球7が開口5内に配置され る。こういう配置は、アルミニウム箔1の上下に配置さ れた圧力パッドを使うことによって可能になる。圧力パ ッドはクッションとして作用する窒化硼素の粉末の様な 離型剤で被覆した厚さ約8ミルのアルミニウム箔で形成 されており、この為、インパクト・プレスのハンマーが インパクトを加える際に球を損傷することがない。更 に、圧力パッドがハンマーの衝撃を吸収する。箔1の1 5 側にある上側の圧力パッドで箔1の13 側にある下側 の圧力パッドよりも厚手であって、前に述べた様に、球 の赤道が箔からずれる様にする。2 c m平方のアレーに 対し、約48フィート・ポンドのインパクト・エネルギ ぎ首尾よく作用することが判った。この為、アルミニウ ムがこの時シリコンに直接的に結合されることは、前に 述べた通りである。

【0020】箱1の後側の面13及び球7の内、この側 にある部分を、この後(e)に示す様にエッチャントを 用いてエッチして、N形層9の内、アレー後面の上にあ る部分を取去り、P形領域を露出する。自然の酸化物を その上に持つアルミニウム箔1がこのエッチャントに対 してマスクとして作用し、アレーの後側13にある層9 の部分だけを除去することが出来る様にする。この後、 アレーを脱イオン水で洗滌してエッチャントを除き、次 に(f)に示す様に、約20ポルトで約1/2分間の 間、10%Hz SO4 溶液内でアレーを陽極酸化して、

露出したシリコン及びアルミニウム箔1を不働態化す る。次に約20ポルトで約1/2分間0.5%H。PO 4 溶液内でアレーを陽極酸化する。陽極酸化に要する時 間は、バスの電流がゼロになって打切られる時の関数で あり、これが約1/2分であることが判った。燐酸を使 うことが重要であり、これは酸化アルミニウム内の孔を 塞ぎ、前にエッチしたシリコン表面に約1,000人の 酸化物層21を作ることが判った。

【0021】次に、陽極酸化の際に形成された後側21 10 を周知の方法で機械的に削磨することにより、陽極酸化 したアレーの球?をラップする。このラッピングによ り、2酸化シリコン21及び若干のシリコンの両方が除 去されて、球7の後面17が平坦になり、17に示す様 に粗面が得られ、この為その上にオーミック接点を形成 することが出来る。次に、約1/2ミルのアルミニウム の薄箔19を(h)に示す様に各々の球7の後面17の 上に配置して、それがラップした平坦な領域17の上に 来る様にする。このアルミニウムは好ましくは530℃ の温度、又は約500万至577℃の範囲内の温度に加 持ち、容易に変形する。従って、元素のアルミニウムが 20 熱するが、前に述べた様な条件がある。加熱された箔1 9がこの後インパクト・プレスによって球?に圧着さ れ、このインパクトによって露出したアルミニウムと、 ラッピング並びにアルミニウム元素によるインパクトの 為に球7の後面で露出したシリコンとの間の結合部が形 成される。前に(d)について述べたのと同じ様に結合 を行なうことにより、シリコン領域11に対する箔の接 点19が形成される。アルミニウム箔1の陽極酸化の 為、この箔の表面の上には厚い酸化アルミニウムがあっ て、箔1の及び箔19の間の短絡を防止する。((i) 30 に示す様に、アレーの前側の面の上に標準的な反射防止 コーティングを適用し、シリコンの光の吸収を改善する ことが出来る。) 従って、シリコンの球の大部分が入射 する太陽光線に露出し、アレーが可撓性であって、使わ れる処理並びに使われる材料が比較的高価でなく且つ数 が少ない様にして、ソーラー・アレーが提供されたこと が理解されよう。

> 【0022】実際の処理工程では、上に述べた様なアレ ーは、別々のアレーとしてではなく、リール形の実施例 で設けるのが普通である。その後、アレーは寸法が例え 40 ば1m×2mである様なモジュールに形成され、こうい う設計のままで試験される。これまで述べた様にして形 成された各々のアレーは各辺が10cm程度であるのが 普通である。

> 【0023】上に述べた様なソーラー・アレーをリール 形に作り、それからモジュールを形成する為には、図3 乃至図6に示す様な手順に従う。最初に図3について説 明すると、この図にはアレー相互接続装置が1次元で示 されている。図3 (a) では、前側の接点箔部材33に 球31を固定した1個のアレー30が示されており、後 50 側箔部材35はまだ球に取付けられていない。図4

(a) にはっきりと示されている様に、アレー30の間 にシム37を挿入する。図4(a)から判る様に、前側 の箱33は後側の箔35より寸法が小さいが、その理由 は後で明らかになる。

【0024】次に図3(b)を見ると、この時後側の箔 35が球31及びシム37と接触していることが判る。 上側の箔33もシムと接触している。これは図1の工程 (h) で、この処理工程の一部分として後側の箔35を 球31に結合する時に達成される。箔33,35はシム 37に接着せず、単にそれと接触しているだけである。 この後、次にシムの上の、図3(b)のV字形記号の場 所で箔をけがき、アレーを互いに分離し且つシムを取外 した後、図3(c)及び図4(c)に示す様な装置を作 る。次に図3(c)及び図4(b)に示す様なアレーを 図4 (c) に示す様に面取りして、後側の箔35の一部 分である4つの耳を作る。これらの耳はアレーの四角の 各辺にあって、A, B, C, Dと記してある。次に図3 (d) 及び図4 (d) に示す様に、耳B, C, Dをアレ 一の下に折返し、その後図3 (e) に示す様に、超音波 の内の1つに結合することにより、このアレーをこの後 のアレーに固定する。

【0025】相互接続工程は図5の3次元表示の装置で 示す様に行なうことが出来る。この装置では、耳Aが伸 出している1つのアレーを、別のアレーの耳B、C又は Dの内の1つとこの耳Aとが接触する様に位置ぎめす る。この手順を直線又はその他の通路で続けて、完全な モジュールを作る。完成されたモジュールが図6に示さ れており、耳Aが隣接するアレー30の耳B、C又はD に固定されて、60個のアレーの直列回路を形成する前 30 19 第2のアルミニウム箔 後に配置された通路を作る。更に、モジュールに対する

入力41及び出力43となる耳を設ける。

【0026】図6のモジュールを形成した後、図2につ いて説明すると、モジュールを試験し、試験に成功すれ ば、モジュールは支持材料等に取り付けられる工程に進 み、その後結合出で耳を超音波で結合し、その後モジュ ールをカプセル封じして、環境に対する適当な封じを施 す。次にカプセル封じしたモジュールを標準的に試験 し、動作し得るモジュールが使える状態になる。

【0027】この発明を特定の好ましい実施例について 10 説明したが、当業者にはいろいろな変更が考えられよ う。従って特許請求の範囲は、この様な全ての変更を抱 括する様に、従来技術から見て可能な限り広く解釈され るべきである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に従ってソーラー・アレーを形成するの に使われる処理工程を示す略図。

【図2】図1のプロセスを示すプロセス線図。

【図3】1次元で表わしたアレー相互接続手順を示す略

結合等により、耳Aをこの後、アレーの耳B, C又はD 20 【図4】2次元で示したアレー相互接続手順を示す略

【図5】3次元で表わしたアレー相互接続を示す略図。

【図6】本発明のモジュールの略図。

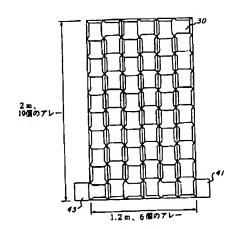
【符号の説明】

- 1 第1のアルミニウム箔
- 5 開口
- 7 シリコンの球
- 9 N型表皮部
- 11 P型内部

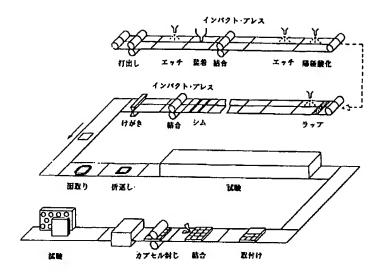
【図1】

		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
打出し	結合	ラップ
	15 11 2 - 39	11/2/-3/31
	4. A.Z.	
	13/	135 175 121
(e)	(4)	(9)
エッチ	エッチ	結合
	15 1175-13	11/2-23,
	玩 定	
2 2/2	135	
(b)	t el	(1) (2)
装着人	隐基础化	反射防止コーティング
""X==<8	11/2-3	11/2
187 ()		
124-24	135 121	
13-5 (1)	(1)	193 (1)

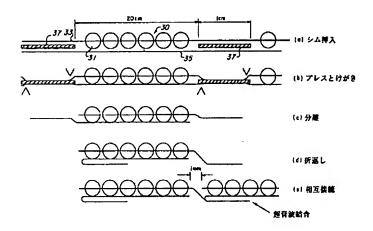
【図6】



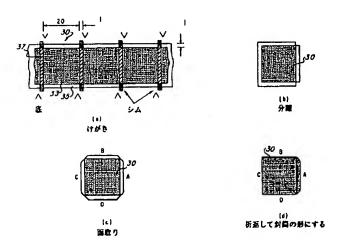
[図2]



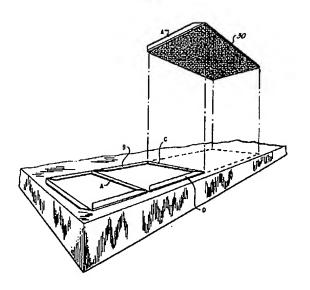
[図3]



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 ロナルド イー. ヘネイ アメリカ合衆国テキサス州リチヤードソ ン, ノツテインガム 748